# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### (19 日本国特許庁 (JP)

### ①特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A)

## 昭58—167777

௵Int. Cl. <sup>3</sup>	識別記号	庁内整理番号	❸公開 昭和58年(1983)10月4日
C 23 F 7/00 B 05 D 1/32		7511—4K 7048—4F	発明の数 2
C 23 C 3/00		7011—4K 7011—4K	審査請求一未請求
C 23 G 1/00 C 25 D 5/02		6575—4K	
11/00	•	7141—4K	(全 9 頁)
C 25 F 1/00		7011—4K	(主 3 具)

#### 69表面処理方法及び装置

②特 願 昭57-51824

②出 顯 昭57(1982)3月29日

70発 明 者 枝村瑞郎

明石市川崎町1-1川崎重工業

株式会社明石工場内

⑫発 明 者 髙本俊二

明石市川崎町1-1川崎重工業

株式会社明石工場内

⑫発 明 者 梶川亨志

明石市川崎町1-1川崎重工業

株式会社明石工場内

仍発 明 者 岡本康治

明石市川崎町1-1川崎重工業

株式会社明石工場内

①出 願 人 川崎重工業株式会社

神戸市中央区東川崎町3丁目1

番1号

①代 理 人 弁理士 大森忠孝

明 翻 書

#### 1 発明の名称

妻面処理方法及び装置

#### 2 特許請求の範囲

- (1) 部分的に化学表面処理の必要な形品の処理部と非処理部との境界全員をゴム状弊性体のサングでシールし、処理部で化学処理用密閉容器の内標の一部を構成し、化学処理用密閉容器内に処理能を充満して処理部の化学処理を行なっことを特象とする表面処理方法。
- (2) 部分的に化学表面処理の必要な配品の処理部 と非処理部との境界全局がゴム状弾性体のリング でシールされ。処理部が処理核の充満される化学 処理用密閉容器の内臓の一部を構成していること を特徴とする表面処理装置。

#### 8 発明の詳細な説明

本発明は部分的に化学表面処理の必要な私品の 表面処理方法及び装置に関するものであり、とこ にいう化学処理とは電解及び無電解処理を含み、 具体的には電気メッキ、無電解メッキ、電解エッ チング、無難算エッチング、無解研摩、化学研摩 毎による処理を含んでいる。

從来郵品の化学処理においては、郵品を処理被 権内に表演する方法がとられており。部分的に処 迎する場合には処理部分のみを被補内に表演する 方法が知られている。しかしその方法では都品の 形状が複雑になれば処理の不要な部分も含めて説 演せざるを得なくなり、不要な私分にまでメッキ が為されるととになり不経済である。又非処理部 分をテープ等により被覆する方法も知られている が、その場合は御品の形状が複雑になると被機作 業が極めて面倒となる。奥に全体にメラミン構脂 糸の歯科を触り、次に処理部の飽料を除去すると とにより処理部のみを築出して、投油する方法( 特輔昭55ー21549)が知られているが、処 腹部の形状が複雑な場合に腹料の除去が困難とな る不具合がある。しかも処理都疣神に難して、非 処職部も含めて全体的に洗浄する必要があり不経

本発明は上紀不具合に集み、部品の処理部のみ

特開昭58-167777(2)

を的難に処理でき、処理都以外は処理故に触れな いためロスが少なく経済的で、しかも自動化の容 易な表面処理方法及び装置を提供することを目的 としており、方法としては部分的に化学表面処理 の必要な郵品の処理部と非処理部との境界全局を ゴム状弊性体のリングでシールし、処理部で化学 処理用密閉容器の内層の一部を構成し、化学処理 用容器内に処理故を充満して処理部の化学処理を 行なうてとを特徴としており、装蔵としては部分 的に化學表面机理の必要な似品の机理都と主机型 都との境界全局がゴム状弾性体のリングでシール され、処理部が処理故の充満される化学処理用容 器の内壁の一部を構成していることを特徴として いる。又、以下の実施例で詳細に述べている如く、 洗浄板。処理板等の交換は、密閉容器内でエアー 吹付けにより前工程の故を除去した後。主として パルプ操作又は接続配管の別換により行ない得る ものである。

次に図面に基づいて本発明を説明する。

(1) ギャ内面動御動都の両骨処理について述べる。

ール6(サング)が嵌め込まれており、ギャ1! の下脚と平坦面5 ●の間に締め代7が形成されて いる。ギャ1の上面に対向する平坦面8mを有す る治典8は中心に孔8bを有し、孔8bの角縁に は平相面8mよりわずかに下方に突出してギャ1 の上面に当接する円環状プムシール9(リング) が嵌め込まれており、ギャ1の上面と平均面88 の間に締め代10が形成されている。ギヤ1、1′ 、スペーサ2、治具5。8はそれぞれ外側円値面 が周一半径を有しており、治具5の外側面50に 僚合固着された円筒形蓋11が、ギャ1。11、 スペーサ2、治異8にそれぞれ篏合して、それら を飼心に保持している。更にギヤ1,1~の内面 の軸盤動都18、1°4及びゴムシール8。6。9 の内側面は同一半径を有しかつ同心に配置されて おり、1つの円筒形内面を有する化学処理用密閉 **畠12を形成している。孔6bは下方に向かうに** 従つて輸小し、治具5の下端に密閉室12用の出 入口13を形成しており、孔8りは上方に向かう に従つて無小し、治具8の上端に密閉宜12用の

従来はギヤ全体を無限塩粕板中に表演した後、 全体を水洗し、スプレーによってギャ内面動類動 都に二硫化モリブデン含有剤を動布することによって製酒処理を行っている。従って処理部以外も 含めて浸漬することから不経済であるばかりでな く、スプレーによるため作業環境が悪化する不具 合まで発生していた。

第1図は本発明による表面処理装置の化学処理 用密閉容器を示す級断正面図である。 2 枚のギヤ 1、1、は円板形の絶像部材(例えば樹脂)なるスペーサ2を介して略平行に上下に動ねる課状 スペーサ2の中心に設けられた孔2 a には円線 カール3 は スペーサ2 の上下的面よりわずかに上 ール3 はスペーサ2 の上下的面よりわずかに上 一の方に、ギヤ1、1、とスペーサ2 との間に 4 を形成している。ギヤ1、の下面に対し、 4 を形成している。ギャ1、の下面に対し、 2 との過程には平均面5 a よりわずかに上 失出してギャ1、の下面に当接する円線状プムシ

出入口130 を形成している。

第2回は本発明による表面処理装置の一実施例を示す概念図である。密閉容器14は配管治異15。16により上下両方から圧能かつ挟持されるようになっており、上方の配管治異15に設けられたの治異16の治異8個の面に設けられたのリング18により被密を保持しつっ出入口13に通路19は治異16の治異5個の面に設けられたのリング18・により被密を保持しつっ出入口13に通過している。密閉容器14に対する配管治異15・16回を左右に動助することができるとうになっている。26はUリングでをまるようになっている。26はUリングで表面できるようになっている。26はUリングで

一方洗浄装置2.7 において。トリクレン紋(又はフロン版)のタンク2.8 内は中板(仕切板28k によつて2.相に分割されており、回収機2.8 の下

特開船58-167777(3)

部にはトリクレン放そ加熱すると一タ30が設けられ、タンク28の上部には加熱により発生したトリクレン散気を複雑する冷却器31が設けられ、緩縮した液を貯蔵権32に送り込むための受皿33が設けられている。更に回収室29中のトリクレン液を浄化して貯蔵機32に送り込む浄化器34がタンク28に接続されている。

前処理装置35では、隣線塩溶液の入つたタンク36の下部に貨幣塩溶液を処路温度に調整する ヒータ37が設けられ、タンク36の横には開象 塩溶液機度等の調整を行なう被調整器38が連結 されている。

清浄水装置3gでは、循環水タンク40及び液 浄水タンク41が設けられ、タンク40、41は 浄水器42を介して連結されている。40°はフィルターである。

興情処理装置 4.3 は熱情処理数(二硫化モリブデン含有液)の貯えられたタンク 4.4 により形成される。

凶中、Vはパルブ、とはポンプを示している。

ンプド66 を介してタンク 4 4 中の胸骨処理故順内 に連通している。

次に上配装置を用いて本製制による製面処理方法を設明する。

- a) 装着 1 治具 5 (第1 節)上にギャ1 ' を乗せ、次にスペーサ2 を介してギャ1 を乗せ、上方より 治具 8 を乗せて、1 ブロック状の密閉容器 1 4 と する。次に密閉容器 1 4 を配管治具 1 5 、 1 6 ( 第 2 図) 間に嵌め、出入口 1 3 、 1 3 ' をそれぞ れ適略 1 9 、1 7 に連過する位置に配置したのち、 治具 1 5 、 1 6 により上下両方向から容器 1 4 を 値めつけて固定する。
- b) 依押:ポンプド41を作動、パルプ V41、V1を組合、他のポンプを停止し、他のパルプを閉じて、トリクレン版(又はフロン版)を密閉容器14内に通し、配管 4.8を介して回収標 2.9 に戻し洗浄を行なう。なお必要に応じとV1、 Vv1 を作動させ為気洗浄を行なってもよい。又、必要に応じて浄化器 3.4を作動させる。次にパルプ V41、V1、及び V81を開いて圧御空気により配

適略17は配数45上に設けられたパルプVg)を 介して圧縮空気ボンペ4.6 に連通し、パルプ Vvi 及びポンプ Pv1 を介してタンク28内の豪気 Mag 内に連油し、パルプ V&I 及びポンプ P&I を介して 貯蔵設備32内に連通している。通路19は配管 4 8 上に敷けられたパルプ V1 を介して蒸気層 47 に連通している。遠路20は配管49上のパルブ VRS を介してポンペ46に連通し、パルプ VESを 介してタンク36の上部60に連通している。通 略21は配售51上のパルプ Vgs を介してポンペ 4 6 に連通し、パルプ VB3 及びポンプ PB8 を介し てタンク41の演奏水中に連通している。通路22 は配管 5 2上のパルプ VB4 を介してポンペ4 6に 差過し、パルプ VB6 を介してタンク 44 内の空間 に連通している。通路23は配督53上のパルプ Va 及びポンプ Les を介してタンク36中の 前 処 理散制中に連治している。 適路24は配置54上 のパルブ VS を介してタンク 4 0 内に翻口し、 フ イルター40′内に水が注がれるように配置され ている。海路25は影響55上のパルプV4及びポ

- 4.5. 4.8 及び密閉客器 1.4 内のトリクレンを追いだした後、誰てのパルブを閉じる。
- o) 例処理:客談14を移動させ、出入口13. . 13が適略20.23に連過するように締着する。次にパルプV8, V88を開き、ポンプP83を作動させて、例処理故を容器14内に導入循環させ、例処理を必要時間行なう。次にポンプP81の理派を切り、パルプV2, V88、V88を聞いて、圧縮空気により回路内の例処理故を除去した後、パルプを離て助じる。
- d) 水秩序: 容器 1 4 を油路 2 1 . 2 4 個に達通 論者した後、上紀作業と同様にパルプ V 8 a . V a . V 8 a 及びポンプ P 8 a を操作して、 清浄水によ り洗浄した後、圧転空気により回路内より水を除 去する。
- 6) 胸骨処型:容器14を油路22、26個に連油輪着した後、パルブV4、 V84、 V84 及びポンプ P84 を操作して調骨処理液を容器内に循環をせ、所定時間内側型を行ない、圧縮空気により回路内より処理液を除去する。

特開昭58-167777(4)

... 以上說明したように本発明によるこの実施例で "は、処理板、洗浄板の個駄がほとんどなくなり経 済的で、しかも処理工程は閉回路内で行なわれる ため作業環境が悪化する恐れはない。又自動化も 収易である。

(2) ピストンのリング課及び頂部のアルマイト処 形について述べる。

従来は非処理部をマスキングし、全体を処理核 に浸漬してアルマイト処理を行なつている。 従っ て処理故に無駄が生じやすく不経済であるばかり でなく、マスキングが面倒な作業となつている。

83図は本発明による表面処理接触の密閉容器をアルマイト処理用に採用した場合を示す機断正面図である。治具56には円衡形内向面57~を育する治具57が一体的に嵌合しており、内向面57~には円衡形内向面58~を有する治具58が指動自在に嵌合しており、これら治其56・57、58は絶機部材(例えば樹脂)により形成されている。治具58の内向面58~にはピストン59が下向きに嵌め込まれており、無数で示す保持部

められている。又穴60の機器化は、ピストン59のリング番68にほぼ一定の間隔を陥てて対向する2枚の円限状電極69(例えば白金又は鉛)の外具体が鑑め込まれている。電数67。69には、関中に概念的に示されているように必要時に通電可能な電影の陰数が接続され、ピストン59には関が接続されている。な名治具56。58及びピストン59は2点銀練で示すクランプ70のピストンシリンダー、71mはピストンロッドである。

第3図の実施例による密防容器73は、第2図において、タンク36内の創処理故を協称歌化用版(例えばしゆう療浴板)に奪き換え、タンク44内の製者処理板を封孔処理板(例えば海費水)に置き換えた表面処理装置に、密防容器14に代えて装着される。

次にアルマイト処理用の上記装置を用いた場合 の本発明による要面処理方法を設明する。

a) 装着;治臭5.6上に内部面5.8.8内の所定位

材72により所定位置に保持されている。 ピスト ン59の下端部は治異56に設けられた穴60に 脳隔を船でて嵌入しており、ピストン59の処理 面と非処理面との境界及び穴60の上端との間は、 治臭58の孔58●の下端に設けられた円硬状シ ール61の下端都61mによりシールされている。 ピストン59、穴60、シール61(リング)に より形成される密閉室62は欠60側の壁の上端 に通路 6 3 A を有し、通路 6 3 A は治具 5 7 及び 出具57の外壁に一体的に固着された連絡部材64 を貧油し、彫材64の上端に削口して出入口65 を形成している。一方穴60の庭面は中心に向か い低くなる円錐面を有しており、下端に設けられ た治路 6 3 日は治具 5 7 及び連絡部材 6 4 を貢港 し、総材64の下端に関口して出入口66を形成 している。更に欠60の円錐面上には多数の孔を 有しかつほピピストン59の半程と同一半発を有 する皿状の無拠67(例えば白金又は鉛)が設置 され、電袖67とピストン59の頂面598との 距離がほぼ一定となるように増售 6 7 の形状が定

版にピストン69を嵌め込んだ治具58を乗せ、 クランプ70により治具56.58及びピストン 59を一体的に固定する。次に連結都材64を第 2回の配管治具15.16間に嵌め、都材64の 出入口65.66がそれぞれ遊略17.19に連 油する位置に配置したのち、治具15.16によ り上下両方向から部材64を締めつけて固定する。 b) 税率; 実施例(1) と間標に行なう。

- o) 水洗浄;容器73を通路21.24側に簡着 した後、実施例(I)の水洗浄と同様に行なう。
- 割孔処理: 0)水洗浄と筒工程で水洗後、タンク44円の沸騰水をポンプ P&4、パルブ V4. V&4

特開昭58-167777(5)

を介して客器73内に送り込み、射孔処理を行な う。

以上範鳴したようにこの実施例では、処職故の 無駄がほとんどなくなり経済的であるばかりでな く、マスキング作業が不要となり作業工程が簡素 化する利点がある。

(3) ピストン外向面のクロムメツキについて述べる。

従来は全体を徴によりメッキを行なつている。 メッキ工程は、(I)取脂、(II)水洗、III)エッチング、 水洗、(物)スマット除去、水洗、(VIII)を取扱理、水 洗、(VIII)シャート処理、水洗、(VIII)クロムメッキ、 水洗、(VIII) 参洗である。

第4 図は本発明による表面処理装置の密別容器をクロムメンキ用に採用した場合を示す影断正面 図、第5 図はその V - V 断面図である。円柱形の治具74は、その上面に円値形穴74 / を有し、穴74 / 内には間隔を隔ででピストン75 が下向きに収納され、保持部材78 によりシールリング76 を介してピストン75 が治異77 に固定され

第6回は多4回。第5回に示す密制容器を組み込んだ本発明による表面処理装置の一実施例を示す数念回である。密的容器98の各出入口86点、…93点、86点、…。93点にはそれぞれ設設装置99、水洗装置100、エンテング装置(以下四示せず)、スマット除去装置、硫酸处验装

ている。保持部材78は丁字形部材79と円板80 と、『宇形都有19に職者して円板80に都材79 を勘定するナット81とから構成されている。ピ ストン 7 5 を協定した治異 7 7 は、宋 🚧 \* に 🛠 合する円額面77mと、穴74mより半径の長い 外向きフランジ?7bとを有し、円筒前77mに 散けられたシールリング82が円錐面77ェと穴 14~との間をシールしており、フランジ77b が治具でもの上離面でもまに当接して、穴でもり 中のピストン75を所定位置に保持している。又 とれら治具74.77は絶縁部材(例えば樹脂) により形成されている。 欠14 · 及びピストン75 により形成される密閉盒83には穴74、側の無 の上端に、知5 例で明らかなように放射状に本例 の場合の本の強略の人が設けられ、名強略の人は 治具74を水平に質適して外盤面85に贈口し、 それぞれ出入口86A、87A、…、93Aを形 成している。只74~の底面は中心に向かい低く なる円錐面を有しており、下端に設けられた通路 9 4 には放射状の本側の場合8 本の通路 9 5 が書

数、ジンケート処理装置、クロムメッキ装置、製売 装置が接続されている。脱脂装置99のタンク 101 内には脱脂液が貯えられており、水洗装置100の タンク102内には水が貯えられている。間中各V はパルプ、Pはポンプを示している。特に103、 104は減圧パルプ、105、106は定圧パルプ であり、定圧パルプ105、106の一畑は外配に 開放されており、タンク101。102内の圧力が 一定に保持されるようになつている。107は圧縮 空気ボンベである。

次に上記装置を用いた場合の本発明による表面処理方法を説明する。

- a) 装着:治具77(剱4図)にピストン76を保 持部材78により固定し、ピストン76を治具74 の穴76<sup>1</sup> 内に挿入して研定位数に固定する。
- b) 脱脂:ポンプド( 第6 図)を作動、パルプVie ・Vib, Via, Vicを観音、脱脂級をタンク 101 より配管 1 0 8 中を、ポンプド」、パルプVie。 Vibを介して油過させ、低間容器 9 8 内を油し、パ ルプVie, Vicを介してタンク 1 0 1 内に戻して、

回路内のエアーを追い出す。次にポンプド1を作 働させたままで、パルプV10。 V10を閉じ、パル ブVg1 、 Via 、 Vib 、 Vid を動けて、 脱脂液 を密防容器98内に健康させ、密閉容器98内の 脱脂を行なう。所定時間経過後、ポンプド を停 上し、パルブ Via 、 Vib 、 Via 、 Vid 、 Vie 、 Vif, Vgi、 Vgiを聞き、圧縮空気により回路 中の脱脂核を追い出し、続いて原次パルプ ¥10. Vio. Vai. Vif を閉じかつパルプ Vgz. Vgs (以下凶示せず)。…、 Vgs 及びパルブ Vsa . V84 (以下図示せず), …。 V84 を聞き、 奥に 鋭いてパルプVaf 。 Vaf (以下図示せず). …。 Vaf 及び Vab 、 Vab (以下数示せず) · …、 Vabを削くてとにより、脱脂液回路以外の油路84 。96内の脱脂液をもことどとく除去した欲、雌 てのパルブを助じる。ととでタンク101内の内 圧は定圧パルプ105により例えば 0.2 ね/ cm² 以下に保たれ、圧制空気が締れ島く設定されてい

なお他2回の実施例と同様に蒸気洗浄を更に行

を操作して水洗を行ない。奥に Vaf 及び他の装 内のパルプVia 、 Vss 、 … 、 Vss 、 パルプVib , Vab, …、Vab、パルブVif, Vaf, …、 Vaf 及びパルプVg1 . Vg8 . …、 Vg8をも無

c) 水洗:上紀原脂工程と向様に、ポンプ PB 及

びパルプ VIA .. … .. Yzo . Ygz . パルプ Vgz

なうようにしてもよい。

作して水洗回路以外の通路84.95内の水を除 去した彼、全てのパルブを閉じる。

阿根にしてその後の工程。(jii) エツチング、水 洗、(物)スマット除去、水洗、(V)硝酸処理。 水洗、(VI) ジンケート処理、水洗、(VII)クロム メンキ、水疣、(yiii) 強洗を行なう。なおクロ ムメツキ工程時には、ピストンヘツド75及び電 独96、97間に所定の電位差を与える必要があ

以上説明したようにとの実施例によれば、処理 歳の無駄がなくなるばかりでなく。 漁路 84 ・ 95 を各8本ずつ放射状に触けて、各々の出入口に各 処理装盤を接続するようにしたので、各処理回路

の撤出性保持が容易となり、しかも処理工程にお いて操作はポンプ及びパルプに限られるため更に 自動化が容易となる利点がある。

(4) パルブの強動部の多篇メッキについて述べる。 第7図は内燃機関用パルブの指動部の多層メツ **キ処理に本発明による製画処理装御を採用した場** 合を示す維斯正面図である。治異109には上蟠 化難口する円筒形の穴110が殴けられ、中心に 孔111\*を有する番111が治具10%の上端 面に一体的に固着されている。 査1 1 1 の欠 112 には治具113が篏合しかつストツパ111 bに より係止固定されており、治具113に設けられ た孔111 = と同心の孔113 = 及び孔111 = には、シールリング114を介して上方よりパル プ115の抑動化116が揮入されており、パル プ115の弁部117が青海性の円環状支持部材 1 1 8 Kより支持されている。 欠 1 1 0、 動 1 1 1 の下面及び船動船116により形成される路路室 119の側面上線には多4回、第5回の実施例と 同様に、放射状にメツキ工程に必要な数の通路 1

20が散けられ、2119下端には、過路121 に連通し放射状かつ適能120と同数の適略 122 が散けられている。電極123は円筒形で欠 110 の側盤に嵌合固着されており、概念的に示すよう に電極128及び支持部材118には必要時に通 誰可能な難惑が接続されている。

第7回の密閉容器119は第6回に示す表面処 避無能において、密閉容器98に代えて使用され る。この場合はもちろんタンク中の処理被は、ニ ツケルメツキ、クロムメツキ毎用に換える必要が ある。又、ニツケル供給兼として、電振123と 看気的に接続されたニツケル色(図示せず)を数 けてもよい。

この実施例によれば、ポンプとパルブ巣作のみ で処理工程を容易に進めることができ、しかも処 建設中への他在の混入が少なくなる。又無据 123 と被処理部材と間隔は常時所定値に保たれるため。 移いメツキ腸の形成も容易となる。従つて例えば ニツケルメツキ後にクロムメンキを施したり。こ れを繰り返し行なつて多層メッキを行なうととも

容易となる。

以上メッキ等、被機を中心に能明したが、もちろん電解研摩や、化学研摩を施す場合においても 効果的に本発明を採用することが容易にできる。 更に圧都空気に代えて他の気体を用いることも適 宜可能であり、例えば酸化防止のために不活性が スを用いてもよい。

以上説明したように、本発明によると以下の利 点がある。

- ① 必要部分のみの表面処理が可能である。
- ① 部分的にしか板に触れないため、使用板、材料、電力等の使用が必要最小限でよく経済的である。
- ② 部局の小数送りが可能で、容易に生変ラインと連結することができる(仕扱品の減少)。
- 電池位置、密制度の形状等それぞれの部品の 条件に適した設定が容易で、かつ均一な処理ができる。従つて複合メッキ、多重メッキも容易に行 なうととができる。
- ⑤ 自動化が容易となる。

ヘッド側の面125や、動9図に示す内施機器のシリンダヘッド126の給鉄気ポート127.1 28の製面をアルマイト処理する場合にも、出具の形状を設えるだけで容易に本発明を採用することができる。

#### 4 図面の簡単な説明

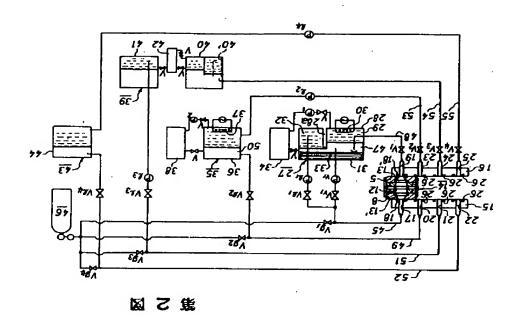
第1図は本発明による表面処理装置の密閉容器を示す報析正面図、第2図は本発明による表面処理装置を示す概念図、第3図、第4図、第7図は密閉容器のそれぞれ別の実施例を示す報析正面図、第5図は第4図のV-V新面図、第6図は表面処理装置の別の実施例を示す概念図、第8図、第9図は更にそれぞれ別の実施例を示す報析正面図である。1,11、59、75,114、126…部品、3,6,9,61、75,114、126…部品、3,6,9,61、75,114、126…部品、3,6,9,61、75,114

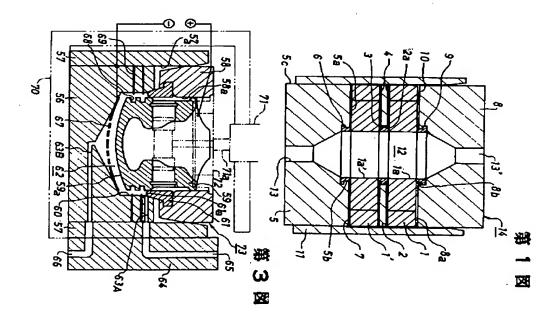
特許出願人 川崎宣工集株式会社 代組人 弁理士 大 森 忠 孝[[

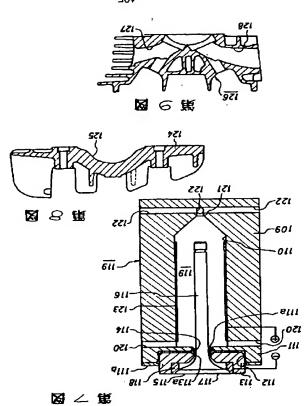
- ⑥ 密閉室内で処理されるため作業環境が良くなる。
- 切 処理部と非処理部との境界全角をゴム状弾性体のリングでシールするようにしたので、処理部と非処理部を明確に区画できることから、最適的に処理部のみを製励処理することができる。

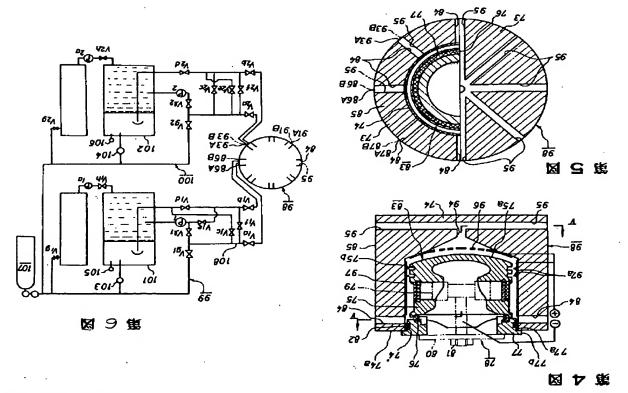
なおリング3、6、9、61、76、114の
材質としては、ゴム以外、造炭の弊性を有する樹脂を用いてもよい。又象2 図の実施例において、密閉容器14を固定し、治異15、16を移動させるようにしてもよい。第1 図に於ては、部品を2 個同時に行なう例を述べたが、1 個の場合でも、3 個以上の場合でも、本効果は同様に得られる。如2 図及び第6 図を具体化するに際し1 組の配管治段で処理する場合について説明したが、並列又は順列に複数組の配置治具を接続し、同時に処理してもよく、第2 図の場合同一配置治真に密閉容器を複数組セットし並行して処理してもよい。なお、第1、3、4、5、7 図は密閉容閣内間が円筒状の場合の例を述べたが、第8、9 図に示す部品の如く門簡状でない場合にも適用用来るのはむろんである。

前日図にポすシリンダヘツド124の燃焼室の









•		(19) Japan Patent Office (JP)	(11) Japanese Unexamined Patent Application Publication No.
		(12) Japanese Unexamined Patent Application Publication (A)	S58-167777
(51) Int. Cl <sup>3</sup> C 23 F 7/100	Identification Code	Office Reference Number	(43) Disclosure Date: October 4, 1983
B 05 D 1/32		7511-4K	Number of Inventions 2
C 23 C 3/00		7048-4F	
C 23 G 1/00		7011-4K	Examination Request: Not yet filed
C 25 D 5/02		7011-4K	-
11/00		6575-4K	
C 25 F 1/00		7141-4K	(9 pages total)
		7011-4K	

(54) Surface Treatment Method and Device	(72) Inventor:	Takashi Kajikawa
	•	Kawasaki Heavy Industries, Inc., Akaishi Factory
(21) Patent Application No. S57-51824	•	1-1 Kawasaki-cho, Akaishi City
(22) Application: March 29, 1982		
	(72) Inventor:	Kenji Okamoto
(72) Inventor: Mizuo Edamura	•	Kawasaki Heavy Industries, Inc., Akaishi Factory
Kawasaki Heavy Industries, Inc., Akaishi Factory		1-1 Kawasaki-cho, Akaishi City
1-1 Kawasaki-cho, Akaishi City		
,	(71) Applicant:	Kawasaki Heavy Industries, Inc.
(72) Inventor: Toshitsugu Takamoto	` ' ••	3-1-1 Kawasaki-cho, Chuo-ku, Kobe City
Kawasaki Heavy Industries, Inc., Akaishi Factory		
1-1 Kawasaki-cho, Akaishi City	(74) Representative:	Tadashi Omori, Patent Attorney

#### Specifications

- Name of the Invention
   Surface Treatment Method and Device
- 2. Scope of Patent Claims
- (1) A surface treatment method in which an elastic rubber ring partially seals the boundary circumference between the treatment portion and the non-treatment portion of parts necessary for chemical surface treatment, the treatment portion constitutes a section of the internal circumference of an airtight surface treatment container, the inside of the airtight surface container is filled with treatment fluid, and chemical treatment is performed on the treatment portion.
- (2) A surface treatment device in which the boundary circumference between the treatment portion and the non-treatment portion is partially sealed with an elastic rubber ring, and the treatment portion makes up a portion of the internal circumference of an airtight chemical surface treatment container filled with treatment solution.
- 3. Detailed Explanation of the Invention

This invention comprises a method and device for the partial surface treatment of parts necessary for chemical surface treatment, and the

"chemical treatment" stated here shall include electrolytic treatment and non-electrolytic treatment; specifically, this will include electric plating, nonelectrolytic plating, electrolytic etching, nonelectrolytic etching, electropolishing, and chemical polishing treatment.

With regard to the chemical treatment of accessories, a method of soaking the accessory in a trough of treatment solution is conventionally taken, and in the case of partial treatment, a method is known which soaks only the treatment portion in a solution trough. However, with this method, it becomes impossible to avoid incidentally soaking unnecessary portions of the accessory when the shape of the accessory is complex, leading to plating of unnecessary portions, which is uneconomical. There is also a known method in which the non-treatment portions are covered with tape, but when the shape of the part is complex in such cases, the covering operation becomes extremely difficult. There is also a known method that applies a melamine resin-type paint to the entire part, then isolates the treatment portion by removing the paint of the treatment portion, and soaks the part (Japanese Unexamined Patent Application Publication No. S55-21549). However, there is the inconvenience that it is difficult

to remove the paint in cases in which the shape of the treatment portion is complex. Furthermore, this method is uneconomical due to the fact that when the treatment portion is to be cleaned, it is necessary to clean the entire accessory, including the non-treatment portion.

This invention reviews the conditions stated above, is able to precisely treat the treatment portion of the accessory, and is economical because loss is minimal due to the fact that the treatment solution does not have contact with any portion of the accessory besides the treatment portion. Furthermore, this invention has the purpose of providing a surface treatment method and device in which automation is simple. The treatment method has the defining characteristics that: an elastic rubber ring partially seals the boundary circumference between the treatment portion and the non-treatment portion of parts necessary for chemical surface treatment, the treatment portion constitutes a section of the internal circumference of an airtight surface treatment container, the inside of the airtight surface container is filled with treatment fluid, and chemical treatment is performed on the treatment portion. The device has the defining characteristics that: the boundary circumference between the treatment portion and the non-treatment portion is partially sealed with an elastic rubber ring, and the treatment portion makes up a portion of the internal circumference of an airtight chemical surface treatment container filled with treatment solution. Furthermore, with regard to the exchange of cleaning fluid and treatment fluid, the primary valve operations and the conversion of connection arrangements are can be easily performed after removing the preprocessing fluid by blowing air into the airtight container, as can be seen in the examples of embodiment stated in detail below.

The following is an explanation of this invention based on the diagrams.
(1) Here we describe the [soaking] treatment of the interior axis oscillation portion of the gears.

[Soaking] treatment is conventionally performed by soaking the entire gear in formic acid salt solution, cleaning the entire gear, and applying with a spray an agent containing disulfide molybdenum to the interior axis oscillation portion of the gear. Therefore, not only is this method uneconomical due to the fact that parts other than the treatment portion are incidentally soaked, but it also brings forth the problem that the operational environment deteriorates due to the use of the spray.

Fig. 1 is a vertical-section front elevation diagram that depicts the airtight chemical treatment container for surface treatment by means of this invention. Two gears, 1 and 1', are stacked vertically and parallel through spacer 2, which is made from an

insulating disk (resin, for example). The toric rubber seal 3 (ring) is established in aperture 2a, which is established at the center of spacer 2. Seal 3 slightly protrudes vertically from the top and bottom of spacer 2, the tips of these protrusions connect with gear 1 and gear 1', and tie 4 is formed between gear 1, gear 1' and spacer 2. Jig 5 that includes the flat wall surface 5a, which faces the lower surface of gear 1', has aperture 5b at its center, and the toric rubber seal 6 (ring), which protrudes slightly above wall surface 5a and connects to the lower surface of gear 1', is established along the rim of aperture 5b. Tie 7 is established between the lower surface of gear 1' and the flat wall surface 5a. Jig 8 that includes the flat wall surface 8a, which faces the upper surface of gear 1, has aperture 8b at its center, and the toric rubber seal 9 (ring), which protrudes slightly below wall surface 8a and connects to the upper surface of gear 1, is established along the rim of aperture 8b. Tie 10 is established between the upper surface of gear 1 and the flat wall surface 8a. The outer surfaces of gear 1, gear 1', spacer 2, jig 5, and jig 8 all have the same radius, and the cylinder 11, which is fastened to the outer surface 5c of jig 5, is [connected] with gear 1, gear 1', spacer 2, and jig 8, and maintains each of them concentrically. Furthermore, the [axis] oscillation portions la and 1'a of the inner surfaces of gear 1 and gear 1', and the inner surfaces of the rubber seals 3, 6, and 9 all have the same radius, and are arranged concentrically. These make up the airtight chemical treatment chamber 12, which has one cylindrical surface. Aperture 5b decreases in size in the downward direction, and becomes the exit and entrance 13 on the lower surface of jig 5 for the airtight chamber 12. Aperture 8b decreases in size in the upward direction, and becomes the exit and entrance 13' on the upper surface of jig 8 for the airtight chamber 12.

Fig. 2 is shows one example of embodiment of the surface treatment device of this invention. The airtight container 14 is designed such that it is compressed and rationed from both the top and the bottom of the arranged jigs 15 and 16, and the pathway 17, which is established in the direction of the arranged jig 15 above, connects with the exit/entrance 13' as it maintains a liquid seal through O-ring 18, which is established on the surface of jig 15 on the side of jig 8. Also, the pathway 19, which is established in the direction of the arranged jig 16 below, connects with the exit/entrance 13, as it maintains a liquid seal through O-ring 18', which is established on the surface of jig 16 on the side of jig 5. By loosening the allowance of the arranged jigs 15 and 16 with respect to the airtight container 14, container 14 is able to oscillate from left to right

between jigs 15 and 16, and it is able to connect each of the exit/entrances 13' and 13 of container 14 with different pathways 20, 21, 22, and 23, 24, 25, respectively. 26 is an O-ring.

With regard to the cleaning device 27, the inside of tank 28, which contains trichloroethylene solution (or freon), is divided in the middle (the partition) 28a into two troughs, and established in the lower portion of the collecting trough 29 is heater 30, which heats the trichloroethylene solution. Established in the upper portion of tank 28 is the cooling device 31, which condenses the trichloroethylene vapor that is emitted from heating, and a collecting plate 33 is established to send the condensed vapor to the accumulation trough 32. Also, the purifier 34, which purifies the trichloroethylene solution of collecting chamber 29 and sends it to the accumulation trough 32, is connected to tank 28.

Within the pre-treatment device 35, established in the lower portion of tank 36, which contains nitric acid salt solution, is heater 37, which regulates the nitric acid salt solution to the treatment [density]. The solution-regulating device 38, which regulates the density of the nitric acid salt solution, is connected to the side of tank 36.

Within the cleaning-water apparatus 39, the circulation-water tank 40 and the cleaning-water tank 41 are established, and tanks 40 and 41 are connected through the cleaning-water device 42. 40' is a filter.

[Soaking] treatment device 43 is made from tank 44, which stores the [soaking] treatment solution (molybdenum disulfide).

Within the diagrams, V indicates a valve, and P indicates a pump. Pathway 17 connects to the compressed gas cylinder 46 through valve V  $_{g1}$ , which is established above arrangement 45, connects to vapor trough 47 inside tank 28 through valve V $_{v1}$  and pump  $P_{v1}$ , and connects to the inside of

accumulating trough 32 through valve  $V_{\ell 1}$  and pump  $P_{\ell 1}$ . Pathway 19 connects to the vapor trough 47 through valve  $V_1$ , which is established above arrangement 48. Pathway 20 connects to the compressed gas cylinder 46 through valve  $V_{\ell 2}$ , which is established above arrangement 49, and connects to the upper portion 50 of tank 36 through valve  $[V_{\ell 3}]$ . Pathway 21 connects to the compressed gas cylinder 46 through valve  $V_{\ell 3}$ , which is established above arrangement 51, and connects to the middle of the cleaning-water of tank 41 through valve  $V_{\ell 3}$  and pump  $P_{\ell 3}$ . Pathway 22 connects to

the compressed gas cylinder 46 through valve  $V_{g4}$ , which is established above arrangement 52, and connects to space within tank 44 through valve  $V_{\ell4}$ . Pathway 23 connects to the pre-treatment [soaking solution] within tank 36 through valve  $[V_3]$  and pump  $[P_{\ell3}]$ , which are established above arrangement 53. Pathway 24 opens into tank 40 through valve  $V_3$ , which is established above arrangement 54. Pathway 24 is arranged such that water pours into filter 40°. Pathway 25 is connected to the inside of the [soaking] treatment solution trough of tank 44 through valve  $V_4$  and pump  $P_{\ell4}$ , which are established above arrangement 55.

The following is an explanation of the surface treatment methods of this invention using the device detailed above.

- a) Installation: Place gear 1' on top of jig 5 (Fig. 1), then place gear 1 through spacer 2. Place jig 8 from the upper direction, and take the resulting creation as 1 block of the airtight container 14. Then insert the airtight container 14 between the arranged jigs 15 and 16 (Fig. 2), and after arranging exit/entrances 13 and 13' to a position connecting with pathways 19 and 17, respectively, fasten and secure container 14 with jigs 15 and 16 both upwards and downwards.
- b) Cleaning: To clean the device, operate the pump  $P_{\ell 1}$ , open valve  $V_{\ell 1}$  and  $V_{1}$ , stop all other pumps, close all other valves, run trichloroethylene (or freon) solution through the airtight container 14, and return the solution to the collecting trough 29 through arrangement 48. Operate  $P_{V1}$  and  $V_{V1}$  and steam clean as necessary. Also, operate purifier 34 as necessary. Next, open valves  $V_{\ell 1}$ ,  $V_{V1}$ ,  $V_{1}$ , and

 $V_{g1}$ , and after expunging the trichloroethylene from arrangements 45, 48, and the airtight container 14, close all of the valves.

c) Pre-treatment: Move the container 14, and fasten exit/entrances 13' and 13 such that they connect with pathways 20 and 23. Then open valves  $V_3$  and  $V_{\ell 3}$ , operate pump  $P_{\ell 3}$ , introduce and circulate the pre-treatment solution into container 14, and conduct pre-treatment for as long as necessary. Then turn off the power supply of pump  $P_{\ell 3}$ , open valves  $V_2$ ,  $V_{\ell 2}$  and  $V_{g2}$ , and after removing with pressurized air the pre-treatment fluid from within the circuit, close all of the valves.

- d) Flushing: After connecting container 14 to pathways 21 and 24, operate valves  $V_{\ell 3}$ ,  $V_3$ ,  $V_{g3}$  and pump  $P_{\ell 3}$  as done above, and after cleaning with purifying solution, remove the water from within the circuit with pressurized air.
- e) Soaking treatment: After connecting container 14 to pathways 22 and 25, operate valves  $V_4$ ,  $V_{\ell 4}$ ,  $V_{g4}$ , and pump  $P_{\ell 4}$ , circulate the soaking treatment solution into the container, conduct soaking treatment for a prescribed length of time, and remove the treatment solution from the circuit with pressurized air.

As in the example of embodiment through this invention explained above, this method is economical in the sense that there is negligible waste of treatment solution and cleaning solution, and because the treatment process is conducted within a closed circuit, there is no threat of deteriorating the operation environment. Furthermore, automation is simple.

(2) Here we describe almite treatment of the ring and upper portion of the piston.

Almite treatment is conventionally performed by masking the non-treatment portion of the accessory and soaking the entire part in treatment solution. Therefore, this method is not only uneconomical in that it induces the waste of treatment solution, but the masking process has become very difficult.

Fig. 3 is a vertical-section front elevation diagram that demonstrates the case in which the airtight container from the surface treatment device of this invention was employed to perform almite treatment. Jig 57, which has the cylindrical interior surface 57a, connects in a unified manner to jig 56, and jig 58, which has the cylindrical interior surface 58a, connects [illegible] freely with interior surface 57a. These jigs 56, 57, and 58 are composed of insulating materials (resin, for example). Piston 59 is connected facedown to the interior surface 58a of jig 58, and is maintained at prescribed locations by the preserving material 72. After opening space, the lower edge of piston 59 is connected to hole 60, which is established in jig 56. The space between the border between the treatment surface and the nontreatment surface of piston 59 and the upper portion of hole 60 is sealed across the lower edge 61a of the toric seal 61 established on the lower edge of aperture 58a of jig 58. The airtight chamber 62, which comprises piston 59, hole 60, and seal 61 (ring), has pathway 63A on the upper edge of the wall on the side of hole 60. Pathway 63A perforates the uniformly secured junction material through jig 57 and the outer wall of jig 57, and opens into the upper

edge of area 64, creating the exit/entrance 65. The bottom surface of hole 60 has a cone that narrows in direction of the center, and the pathway 63B, which is established on the lower edge, perforates jig 57 and the connecting material 64, opening into the lower edge of area 64 and forming the exit/entrance 66. The cone surface of hole 60 has several apertures, and electrode 67 (platinum or lead, for example) is established on a plate surface that has approximately the same radius as piston 59. The shape of electrode 67 is determined such that the distance between electrode 67 and the top 59a of piston 59 is constant. Also, on the wall of hole 60, two toric electrodes 69 (platinum or lead, for example) are buried at equal intervals in the ring 68 of piston 59. As shown conceptually in the diagram, cathodes with electrification ability are connected to electrodes 67 and 69 when necessary, and an anode is connected to piston 59. Also, jigs 56, 58, and piston 59 are uniformly rationed with clamp 70 as the dotted line indicates. 71 is the piston cylinder for clamp 70, and 71a is the piston rod.

In Fig. 2, the airtight container 73 from the example of embodiment in Fig. 3 is installed by replacing the pre-treatment solution from tank 36 with anodizing solution (oxalic acid, for example), and replacing the airtight container 14 in the surface treating device in which cleaning solution from tank 44 is replaced with sealing solution (boiling water, for example).

Next, we explain the surface treatment method of this invention in cases in which the almite treatment device detailed above is employed.

- a) Installation: Place jig 58, which contains piston 59 at a prescribed position within interior surface 58a, on top of jig 56, and uniformly secure jigs 56, 58, and piston 59 with clamp 70. Next, fasten the linking material 64 between the arranged jigs 15 and 16 from Fig. 2, and after positioning exit/entrances 65 and 66 such that they connect with pathways 17 and 19, respectively, fasten and secure material 64 from both the top and the bottom of jigs 15 and 16.
- b) Cleaning: Perform in the same manner as in example of embodiment (1).
- c) Flushing: After fastening container 73 on the side of pathways 21 and 24, conduct flushing in the same manner as in example of embodiment (1).
- d) Anodization: After moving container 73 and fastening it on the side of pathways 20 and 23, open valves  $V_2$  and  $V_{\ell 2}$ , operate pump  $P_{\ell 2}$ , fill the interior of airtight container 73 with anodizing solution, and apply a potential difference such that the piston 59 is positive and the electrodes 67 and 69 are negative. After completing this anodization

process, remove the potential difference, open valve  $V_{g3}$ , and remove the solution from the circuit with pressurized air.

e) Sealing treatment: After cleaning the water in the same manner as that which is prescribed in c) above, send the boiling water from tank 44 to container 73 through valves V<sub>4</sub>, V<sub>4</sub>, and pump P<sub>44</sub>.

As explained above, in this example of embodiment, not only is this method economical in the sense that there is negligible waste of treatment solution, but it also has the advantage that it simplifies the operation process by making the masking operation unnecessary.

(3) Here we describe the process of chrome plating the interior surface of the piston.

Plating is conventionally performed by soaking the entire accessory. The plating process is as follows: (i) resin removal, (ii) flushing, (iii) etching, flushing, (iv) smut removal, flushing, (v) nitric acid treatment, flushing, (vi) zincate treatment, flushing, (vii) chrome plating, flushing, and (viii) cleaning.

Fig. 4 is a vertical-section front elevation diagram that demonstrates the case in which the airtight container from the surface treatment device of this invention was employed to perform chrome plating, and Fig. 5 is the cross-section of V-V. The cylindrical jig 74 has on its upper surface the cylindrical hole 74', and after leaving space, piston 75 is stored facedown within hole 74', and piston 75 is fixated to jig 77 through the sealing ring 76 from the preserving element 78. The preserving element 78 is made from the nut 81 that fixates the T-shaped element 79 to disc 80 after the T-shaped element 79 and the disk 80 are [joined] at the T-shaped element. The jig 77, which fixates piston 75, is comprised of cylindrical surface 77a, which is connected to hole 74, and the outward-facing flange 77b with a larger radius. The sealing ring 82, which is established on the cylindrical surface 77a, seals the space between cylindrical surface 77a and hole 74'. The flange 77b is connected to the upper edge surface 74a of jig 74, and jig 77 maintains piston 75 at prescribed positions in hole 74'. Also, these jigs 74 and 77 are made of insulating materials (resin, for example). In the airtight chamber 83, which comprises hole 74' and piston 75, eight radial pathways 84 are established on the upper wall of hole 74' in the case of this example, as can be seen in Fig. 5. Each of the pathways 84 penetrate jig 74 horizontally, open into the exterior wall surface 85, and create exit/entrances 86A, 87A, ..., 93A, respectively. Hole 74' has on its bottom surface a cone that narrows in direction of the center, and eight radial pathways 95 are connected to

pathway 94, which is established on the lower edge. Each of the pathways 95 penetrate jig 74 horizontally, open into the exterior wall surface 85. and create exit/entrances 86B, 87B, ..., 93B, respectively. The cone surface of hole 74' has several apertures, and electrode 96 (platinum or lead, for example) is established on a plate surface that has approximately the same radius as piston 75. The shape of electrode 96 is determined such that the distance between electrode 96 and the foremost tip 75a of piston 75 is constant. Also, toric electrode 97 is secured on the wall of hole 74', and the inwardfacing flange-shaped protuberance 97a, which is on the opposite side as ring 75b of piston 75, is uniformly established. As shown conceptually in the diagram, cathodes with electrification ability are connected to electrodes 96 and 97 when necessary, and an anode is connected to piston 75.

Fig. 6 is a conceptual diagram that demonstrates one example of this surface treatment device of this invention, incorporating the airtight container shown in diagrams 4 and 5. Each of the exit/entrances 86A,..., 93A, and 86B,..., 93B or the airtight container 98 are connected to the resinremoving device 99, the flushing device 100, the etching device (not shown in the diagram), the smutremoving device, the nitric acid treatment device, the zincate treatment device, the chrome plating device. and the cleaning device, respectively. Resinremoving solution is stored inside tank 101 of the resin-removing device 99, and water is stored inside tank 102 of the flushing device 100. In the figure, Vs indicate valves, and Ps indicate pumps. 103 and 104 are decompression valves, and 105 and 106 are constant-pressure valves. One side of the constantpressure valves 105 and 106 is opened to the exterior. and the pressure within tanks 101 and 102 remain constant. 107 is a decompressed gas container.

Next, we explain the surface treatment method of this invention in cases in which the device detailed above is employed.

- a) Installation: Secure the piston 75 to jig 77 (Fig. 4) with the preserving element 78, then insert and secure piston 75 to the prescribed position in the hole 74' of jig 74.
- b) Resin-removal: Operate pump  $P_1$  (Fig. 6), open valves  $V_{1e}$ ,  $V_{1b}$ ,  $V_{1a}$  and  $V_{1c}$ , and pass the resin-removing solution from tank 101 into the center of arrangement 108 through pump  $P_1$ , valve  $V_{1e}$ , and valve  $V_{1b}$ . Pass the solution into the airtight container 98, return the solution tank 101 through valves  $[V_{1a}]$  and  $V_{1c}$ , and expunge the air within the circuit. Then while operating pump  $P_1$ , close valves

 $V_{1e}$  and  $V_{1e}$ , open valves  $V_{\ell 1}$ ,  $V_{1a}$ ,  $V_{1b}$ , and  $V_{1d}$ , circulate the resin-removing solution into the airtight container 98, and conduct resin-removal within airtight container 98. After a prescribed length of time has passed, stop pump P<sub>1</sub>, open valves V<sub>1a</sub>,  $V_{1b}$  ,  $V_{1c}$  ,  $V_{1d}$  ,  $V_{1e}$  ,  $V_{1f}$  ,  $V_{\ell l}$  , and  $V_{g\,l}$  , and expunge the resin-removing solution from the circuit with pressurized air. Then, in turn, close valves V<sub>1c</sub>,  $V_{1e}$ ,  $V_{\ell 1}$ , and  $V_{1f}$ , open valves  $V_{g2}$ ,  $V_{g3}$  (not shown in diagram)...  $V_{g5}$  and valves  $V_{2a}$  and  $V_{3a}$ (not shown),..., open V[illegible]a, then open valves  $V_{2f},...,V_{3f}$  (not shown),...,  $V_{[illegible]f}$ , and  $V_{2b},V_{3b}$ (not shown),..., [V<sub>8b</sub>]. After removing all of the resin-removing solution from the pathways 84 and 95 that are not part of the resin-removing circuit by operating the valves in this way, close all of the valves. At this point, constant-pressure valve 105 maintains the internal pressure within tank 101 at a level less than 0.2 kg/cm<sup>2</sup>, for example, and pressurized air is established with good circulation.

Also, it would be permissible to further conduct vapor cleaning in a manner identical to that of the example of embodiment in Fig. 2.

c) Flushing: In a manner identical to that of the resin-removing process of described above, operate pump  $P_2$  and valves  $V_{2a}$ , ...,  $[V_{2e}]$ ,  $[V_{\ell 2}]$  and  $[V_{g2}]$ , conduct flushing, and then further operate valve  $V_{2f}$ , and the other valves in the equipment; valves  $V_{1a}$ ,  $V_{3a}$ , ...,  $V_{8a}$ , valves  $V_{1b}$ ,  $V_{3b}$ , ...,  $V_{8b}$ , valves  $V_{1f}$ ,  $V_{3f}$ , ...,  $V_{8f}$ , and valves  $V_{g1}$ ,  $V_{g3}$ , ...,

V<sub>g8</sub>. After removing all of the resin-removing solution from the pathways 84 and 95 that are not part of the resin-removing circuit by operating the valves in this way, close all of the valves.

Conduct the operations to follow in the same manner: (iii) etching, flushing, (iv) smut removal, flushing, (v) nitric acid treatment, flushing, (vi) zincate treatment, flushing, (vii) chrome etching, flushing, (viii) soaking. When performing chrome etching, it is necessary to apply a potential difference to prescribed locations between the piston head 75 and electrodes 96 and 97.

As explained above, in this example of embodiment, not only does this method limit the amount of treatment solution waste to a minimum, eight of each of the radial pathways 84 and 95 are established, and each of the treatment devices is connected to each of the exit/entrances, so

maintaining the solution seal becomes simple. Furthermore, because the operations of the treatment process are limited to the operation of valves and pumps, automation becomes even simpler.

(4) The multi-layer plating of the oscillating portions of the valves will be discussed below.

Fig. 7 is a vertical-section front elevation diagram that demonstrates the case in which the surface treatment device of this invention is employed to perform [multi-layer] plating on the oscillating portion of a valve for an internal combustion engine. The cylindrical hole 110 is established on the upper edge of jig 109, and [illegible] 111, which contains aperture 111a in the center, is uniformly secured to the upper edge surface of jig 109. Jig 113 is inserted in the hole 112 of [illegible] 111, and it is secured tightly with stopper 111b. In aperture 111a, which is established in jig 113, and the concentric apertures 113a and 111a, oscillating part 116 of the valve 115 is inserted from the upper direction through sealing ring 114, and the petal portion 117 of the valve 115 is supported by the conductive cylindrical supporting element 118. In the upper portion of the airtight chamber 119, which is comprised of hole 110, the lower surface of [illegible] 111, and the oscillating portion 116, a number of radial pathways 120 are created as necessary for plating, in the same manner in which they were created in the examples of embodiment in diagrams 4 and 5. In the lower portion of the chamber 119, radial pathways 122 are created (equal to the number of pathways 120) that connect to pathway 121. The electrode 123 is attached to the wall of cylindrical hole 110, and as shown conceptually in the diagram, a power supply with electrification ability is connected to electrode 123 and supporting element 118 when necessary.

The airtight container 119 of Fig. 7 used in placed of the airtight container 98 in the surface treatment device of Fig. 6. In this case, it is of course necessary to exchange the treatment solution in the tank with solution for nickel or chrome plating. Also, as a nickel supply source, a nickel electrode that is electrically connected with the electrode 123 (not shown in diagram) may be constructed.

Through this example of embodiment, it was possible to easily progress the treatment process using only the operations of pumps and valves, and the amount of mixture of treatment solution with other solutions was reduced. Furthermore, because the [illegible] of electrode 123 and treatment portion is always maintained at a constant value, it becomes simple to create diluted plating solutions. Therefore, if chrome plating is performed after nickel plating, for example, it becomes simple to repeat this process to perform multi-layer plating.

The plating methods above are primarily explained in terms of [covering], but is simple to apply this invention effectively to cases in which electropolishing or chemical polishing are implemented. Furthermore, it is suitable to use other gases in place of pressurized air; for example, inert gases may be used in order to prevent oxidation.

As explained above, this invention has the

following merits:

1) It is possible to conduct surface treatment of the necessary portions alone.

- 2) This invention is economical in the sense that, because the accessory only partially comes in contact with the solution, the use of solutions, materials and electricity are kept at an absolute minimum.
- 3) It is possible to send a fraction of the accessory, so it is possible to have a direct connection with the production line (reduction of replacement parts).
- 4) The electrode position and airtight chamber shape can be easily set to meet the conditions of a specific accessory, and uniform treatment is possible. Therefore, it is simple to perform compound plating and multi-layer plating as well.
- 5) Automation is made simple.
- 6) Because treatment is performed within an airtight chamber, the operation environment improves.
- 7) This invention is designed such that the entire border between the treatment portion and the non-treatment portion is sealed with an elastic rubber ring, so from the fact that the regions of the treatment portion and the non-treatment portion can be clearly defined, it is possible to actively expose only the treatment portion and perform precise surface treatment on the surface portion alone.

Furthermore, with regard to the material quality of the rings 3, 6, 9, 61, 76, and 114, any resin of moderate elasticity may be used in place of rubber. Also, with regard to the example of embodiment in Fig. 2, it would be suitable to fixate the airtight container 14 and move the jigs 15 and 16. As for Fig. 1, we described an example of conducting treatment on two parts simultaneously, but this result can be achieved in the same way even if one part, or even three or more parts are used. When embodying diagrams 2 or 6, we explained the case in which treatment is performed with one group of arranged jigs, but multiple groups of arranged jigs can be connected in parallel or in series and be processed simultaneously, and in the case of Fig. 2, it would be suitable to set multiple sets of airtight containers on the same jig arrangement and treat them in parallel.

Also, in diagrams 1, 3, 4, 5, and 7, we described an example in which the interior surface of the airtight container was cylindrical, but as can be seen from the accessory in Figures 8 and 9, this invention can of course be applied to non-cylindrical shapes.

In cases in which almite treatment is performed on the head-side surface 125 of the combustion chamber of the cylinder head 124 shown in Fig. 8, or on the wall surface of the gas supply/drain 127 or 128 of the cylinder head from the internal combustion engine shown in Fig. 9, this invention can be employed by simply changing the shape of the jigs.

4. Simple Explanation of Diagrams Figure 1 is the vertical-section front elevation diagram showing the airtight container from the surface treatment device of this invention. Figure 2 is a conceptual diagram showing the surface treatment device of this invention. Figures 3, 4, and 7 verticalsection front elevation diagrams, each of which shows a different example of embodiment of the airtight container. Fig. 5 is shows the cross-section of the V-V from Fig. 4, and Fig. 6 is a conceptual diagram that shows a different example of embodiment of the surface treatment device. Figures 8 and 9 are vertical-section front elevation diagrams showing additional examples of embodiment. 1, 1', 59, 75, 115, 124, and 126 are parts, 3, 6, 9, 61, 76, and 114 are rings, and 14, 73, 98, and 119 are airtight containers for chemical treatment.

Patent Applicant: Kawasaki Heavy Industries, Inc. Representative: Tadashi Omori, Patent Attorney [seal]